

日本表面真空学会第3回オンライン真空講習会入門講座受講報告

共通機器部門情報基盤機器管理班 松下 昌史

1. はじめに（目的等）

透過電子顕微鏡及び半導体製造装置の真空機器に関連する点検業務を行っている。対象となる機器のしくみを理解するために真空技術の基礎を学び、点検技術のスキル向上を図るため本講座を受講した。

2. 期間・内容等

受講期間：令和4年7月5日～8月31日※7月22日までに受講済

講義形式：オンデマンド講義（Air Courseを使用）

講師：石橋 拓弥 准教授

日本表面真空学会 教育・育成委員会委員（所属：高エネルギー加速器研究機構）

3. 講習内容

事前に郵送されたレジュメをもとに以下の動画を視聴した。

- (1) 真空技術の基礎 81分（動画×5本）
- (2) 真空計測（種々の真空計とそれぞれの計測原理）51分（動画×3本）
- (3) 真空排気（種々の真空ポンプとそれぞれの排気原理）45分（動画×2本）
- (4) 真空材料・真空部品 64分（動画×3本）
- (5) 安全、環境保全、省エネルギー 17分（動画×1本）
- (6) 真空技術に関する関連動画紹介 34分（動画×11本）

4. まとめと感想

本講座は真空技術を初めて学ぶ受講生を対象にしており、動画の構成と講師の分かり易い説明によって受講後に真空技術の概要が理解できたと感じた。

特に点検対象となるロータリーポンプ（油回転ポンプ・スパッタイオンポンプ等）のしくみと排気原理や使用上の注意点について動画では詳細な説明があり有意義であった。

本講座を受講して理解した真空技術を今後の点検作業に生かしていきたいと思う。